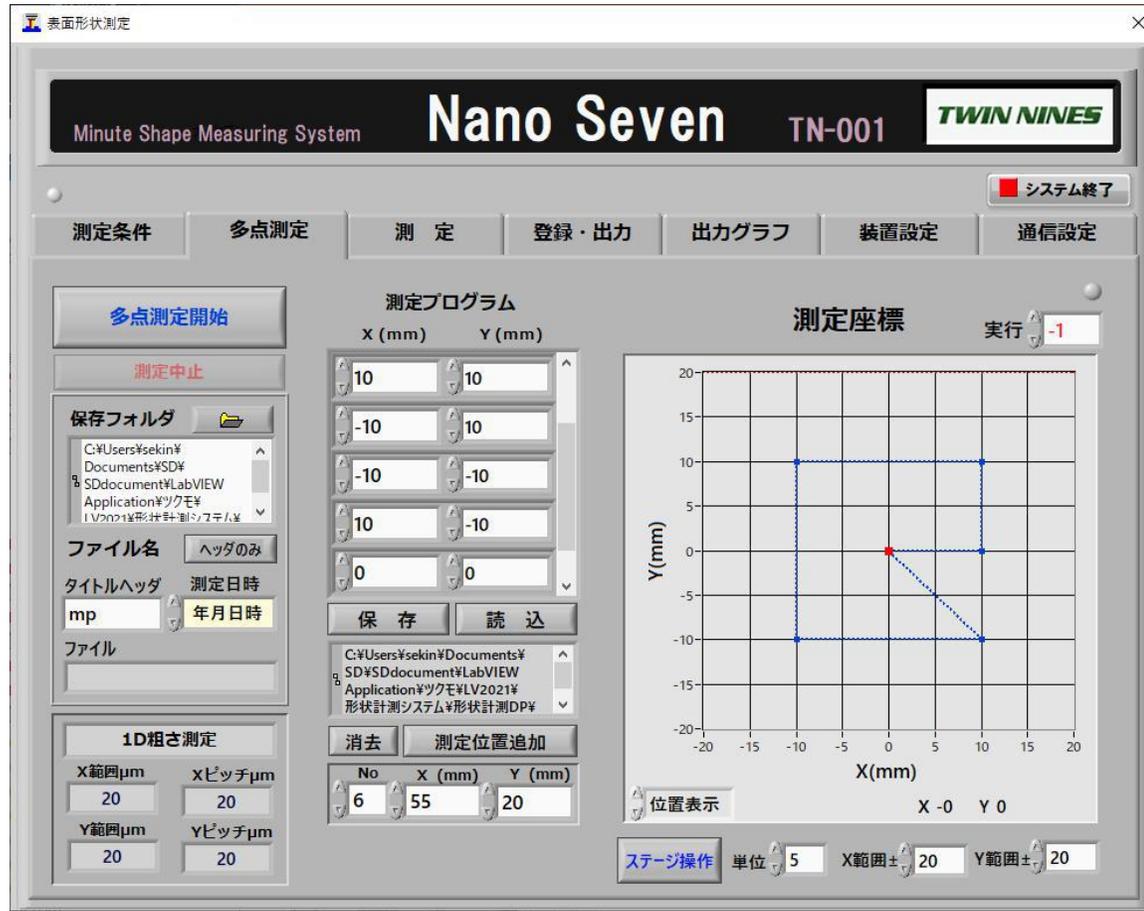
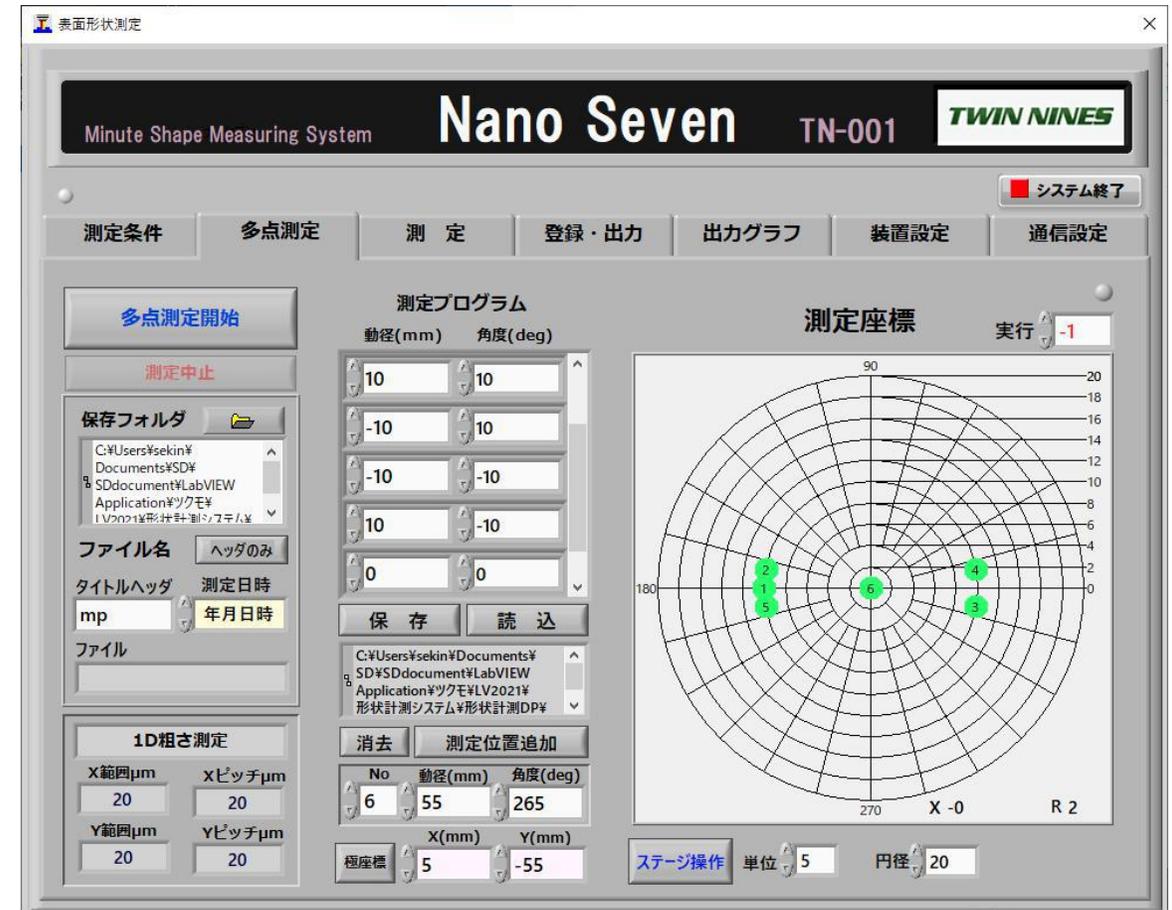


多点自動測定（多点測定画面）

サンプルの各位置を設定順に自動測定



2D駆動自動試料台



回転駆動自動試料台

1 D、2 D表面形状解析（測定条件画面）

表面形状測定

Minute Shape Measuring System Nano Seven TN-001 TWIN NINES

システム終了

測定条件 多点測定 測定 登録・出力 出カグラフ 装置設定 通信設定

条件設定

1D粗さ測定 測定条件

作成日時 21/12/11 19:45 条件説明 AI精密研削部品用 X範囲(μm) 100 Xピッチ(μm) 0.1 試料厚(mm) 0

作成者 服部義次 反復回数 0

	測定モード	作成日時	作成者	条件説明
1	0 1D粗さ測定	21/12/11 19:45	服部義次	AI精密研削部品用
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

C:\Users\sekin\...テム形状計測DP¥table¥condition0.tbl

ステージ操作

作業位置 測定原点

1 D測定用

表面形状測定

Minute Shape Measuring System Nano Seven TN-001 TWIN NINES

システム終了

測定条件 多点測定 測定 登録・出力 出カグラフ 装置設定 通信設定

条件設定

2D粗さ測定 測定条件

作成日時 21/12/11 19:46 条件説明 AI精密研削部品用 X範囲(μm) 100 Xピッチ(μm) 0.1 試料厚(mm) 0

作成者 服部義次 Y範囲(μm) 100 Yピッチ(μm) 0.1

	測定モード	作成日時	作成者	条件説明
1	0 1D粗さ測定	21/12/11 19:45	服部義次	AI精密研削部品用
2	1 2D粗さ測定	21/12/11 19:46	服部義次	AI精密研削部品用
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

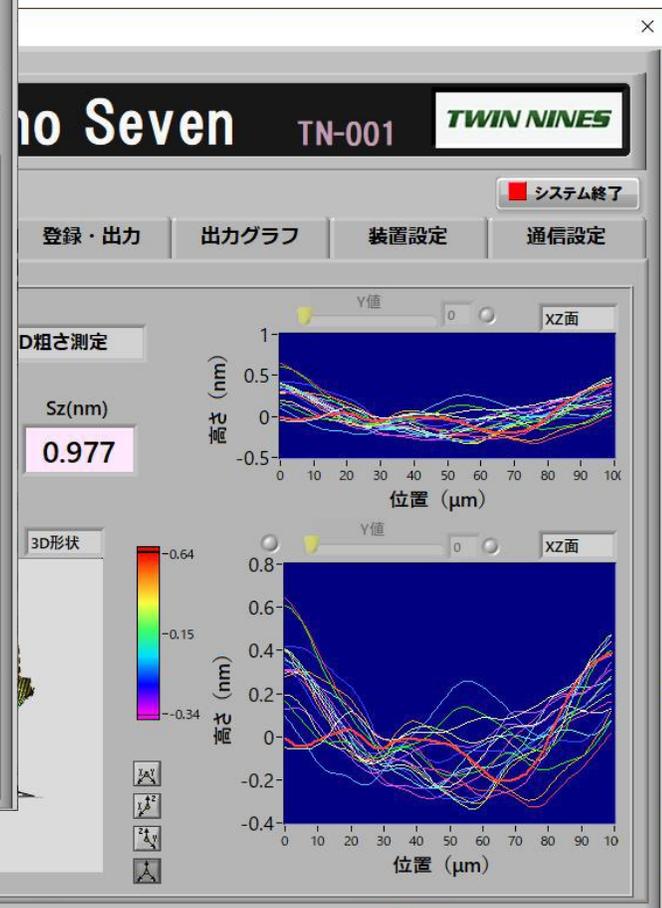
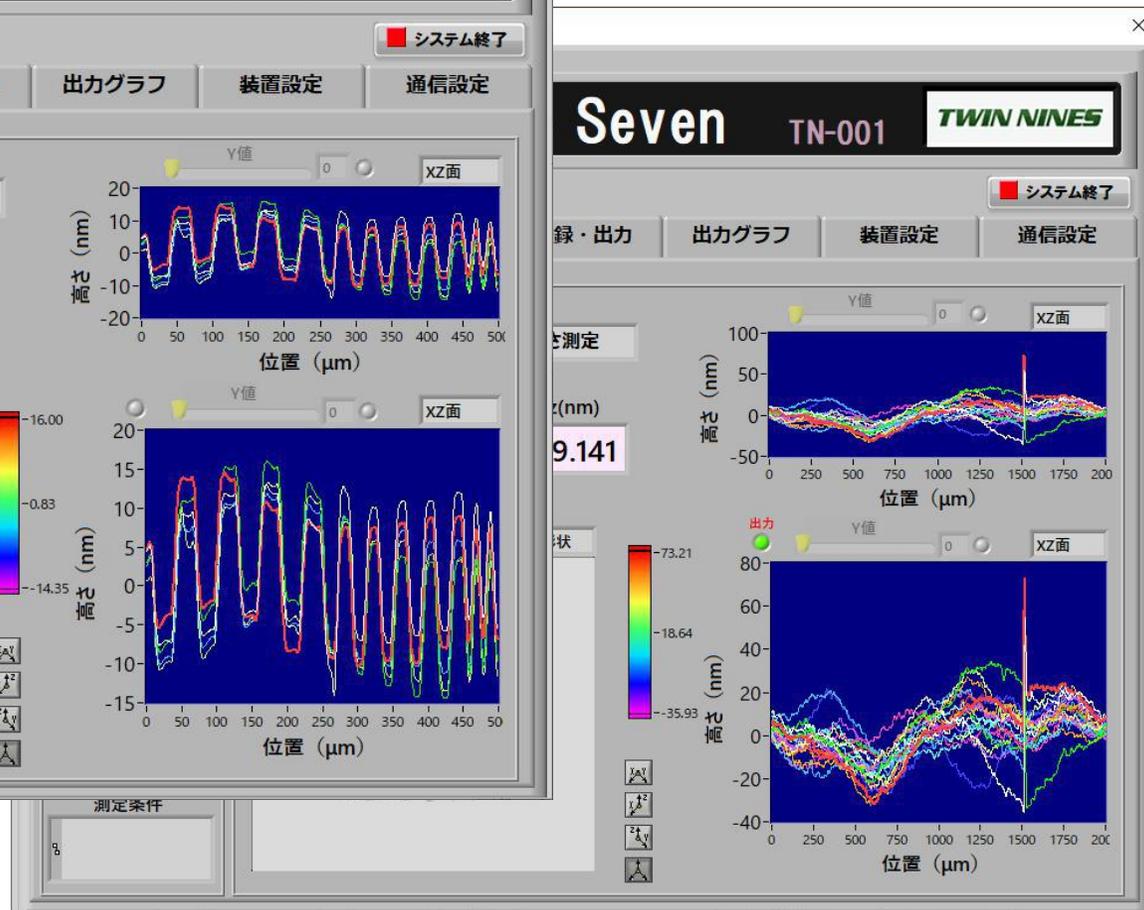
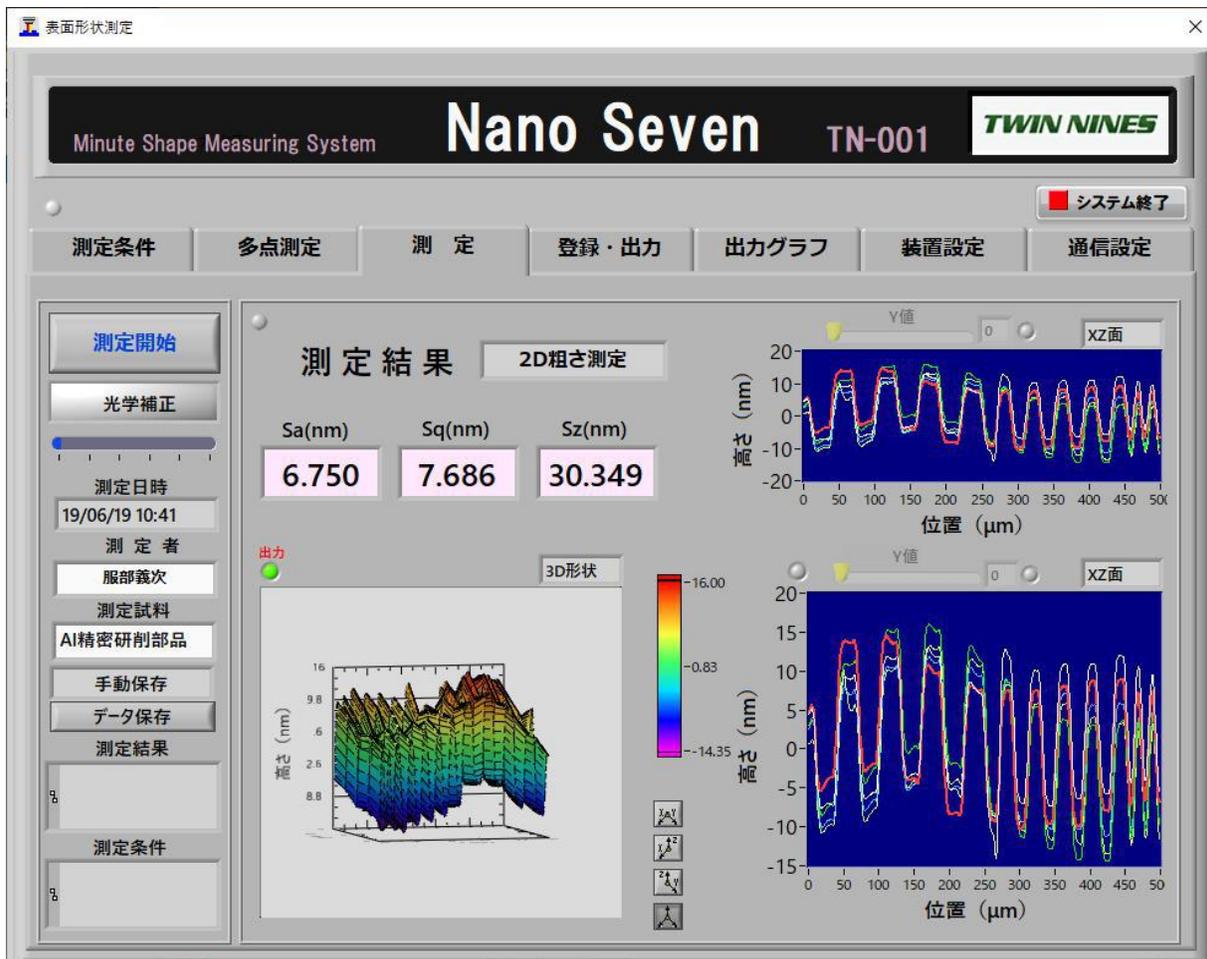
C:\Users\sekin\...テム形状計測DP¥table¥condition0.tbl

ステージ操作

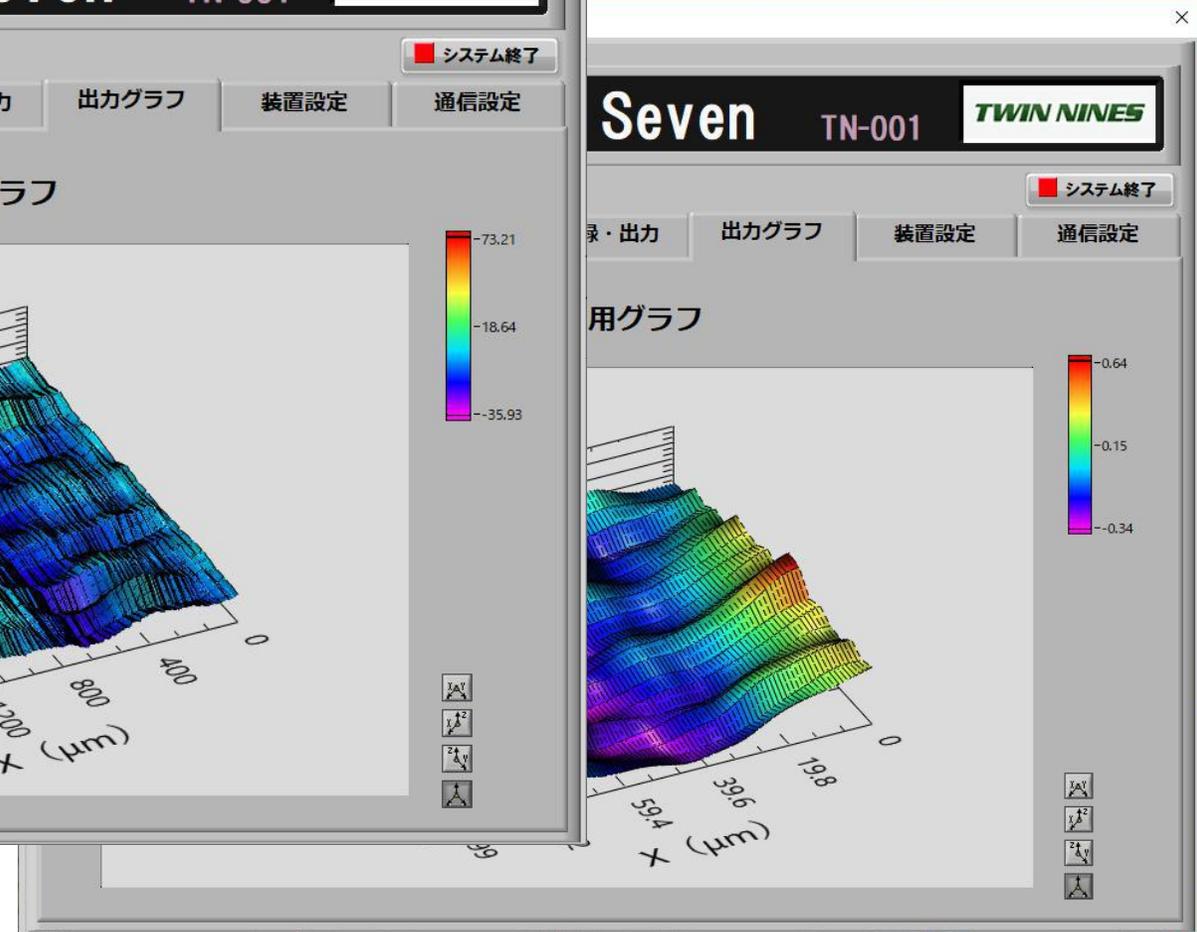
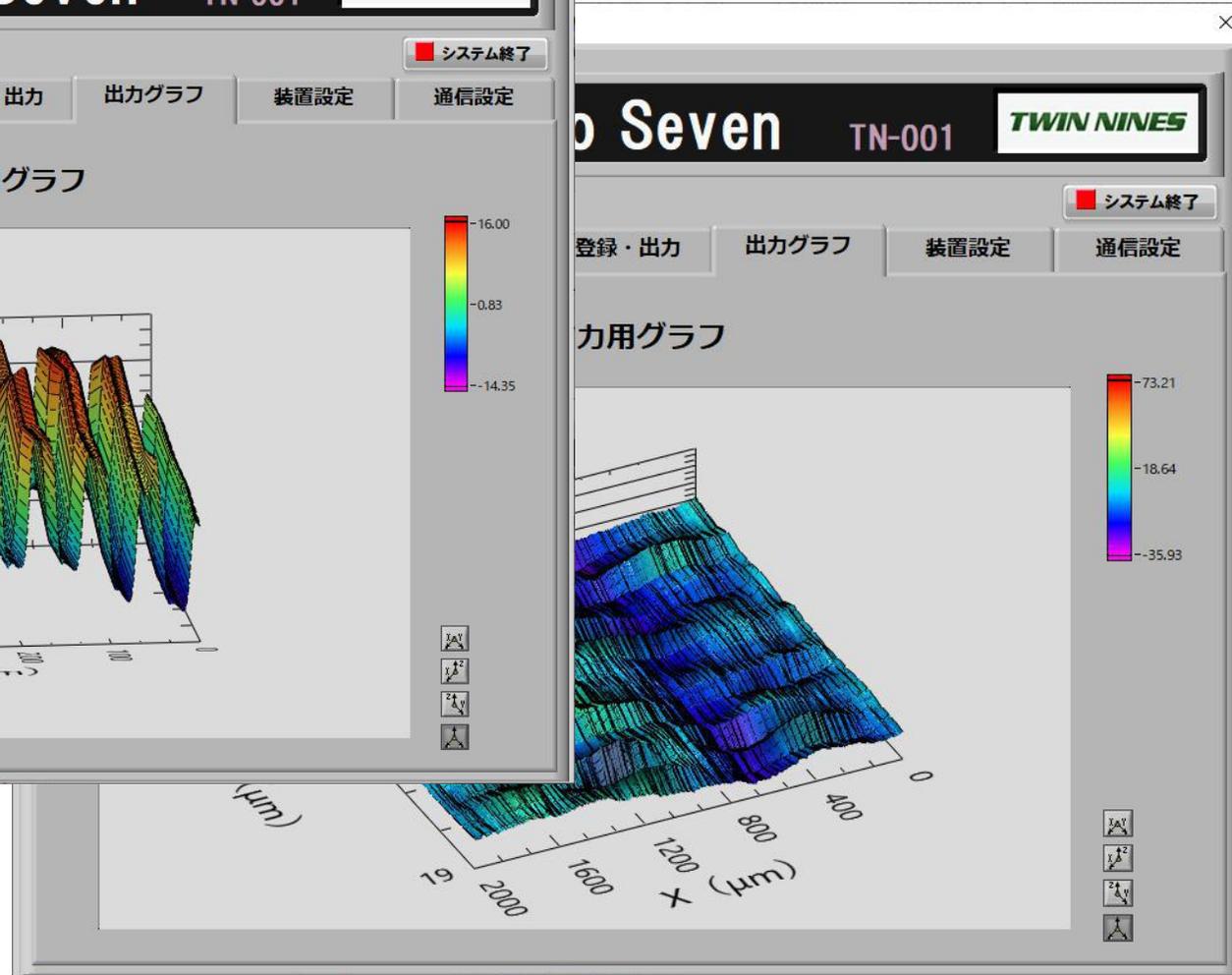
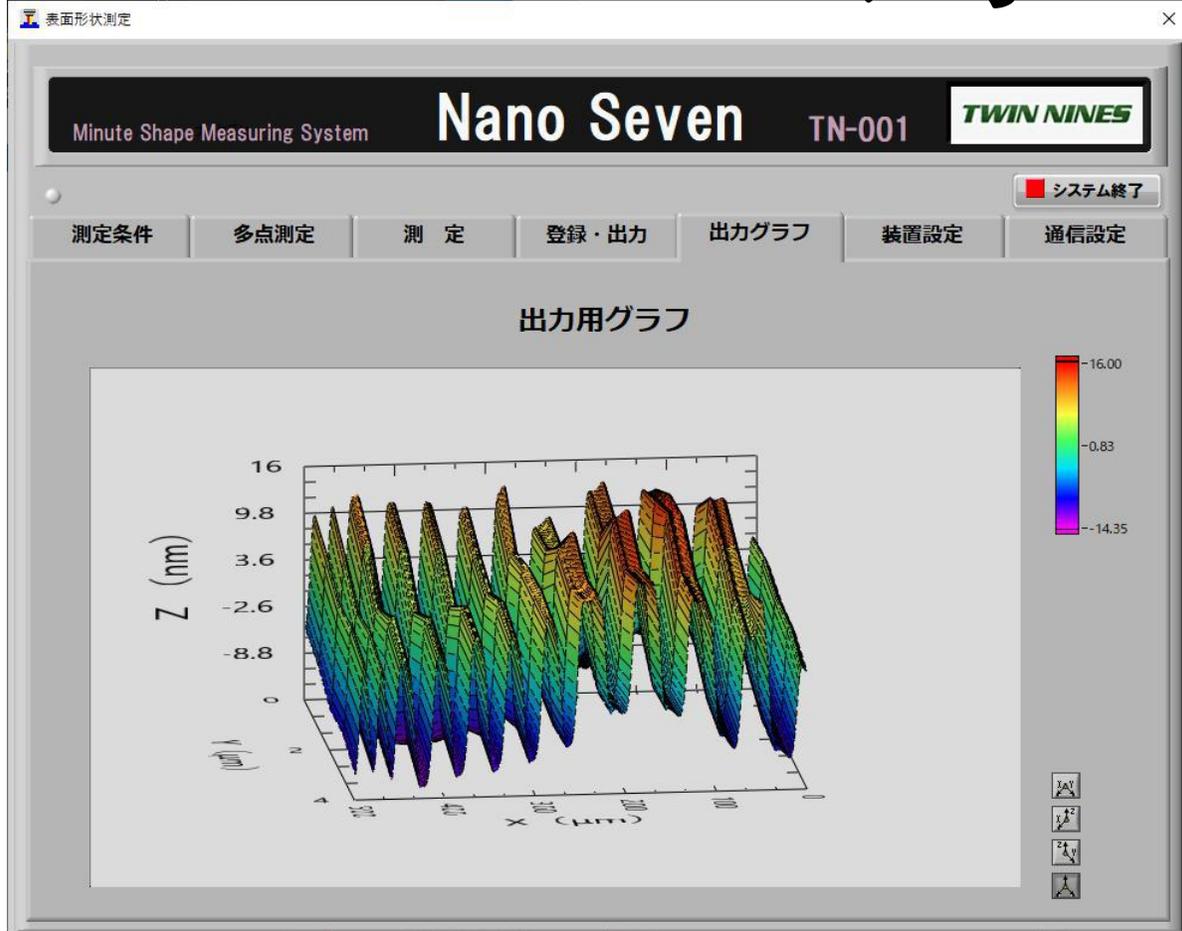
作業位置 測定原点

2 D測定用

測定結果解析 (測定画面)



レポート出力図



PDFレポート

TKM00

2021/12/11

形状測定結果

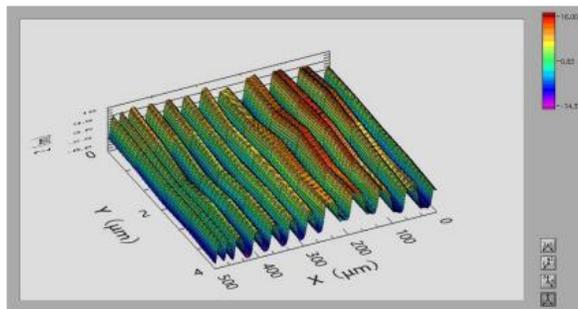
測定条件

測定日時 : 21/09/28 12:08
測定試料 : VLSI インクリ
所要時間 : 16.790000sec
測定者 : ツクモ工学
測定モード : 2D 粗さ測定
保存フォルダ : C:\Program Files (x86)\Y表面測定 DPY計測結果

解析値

Sa(nm)	Sq(nm)	Sz(nm)
6.750	7.686	30.349

測定結果



TKM00

2021/12/11

形状測定結果

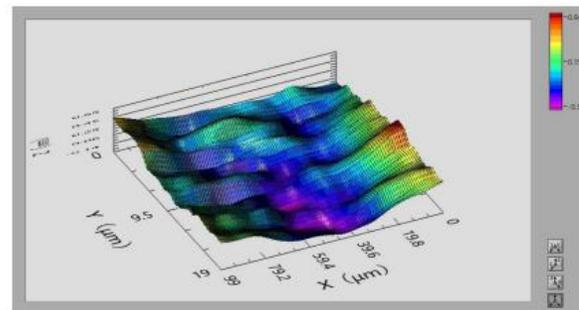
測定条件

測定日時 : 21/09/28 15:41
測定試料 : Si ウエハー
所要時間 : 23.787000sec
測定者 : ツクモ工学
測定モード : 2D 粗さ測定
保存フォルダ : C:\Program Files (x86)\Y表面測定 DPY計測結果

解析値

Sa(nm)	Sq(nm)	Sz(nm)
0.144	0.179	0.977

測定結果



TKM00

2021/12/11

形状測定結果

測定条件

測定日時 : 21/09/28 11:02
測定試料 : SiC Φ150 サンプル
所要時間 : 204.639000sec
測定者 : ツクモ工学
測定モード : 2D 粗さ測定
保存フォルダ : C:\Program Files (x86)\Y表面測定 DPY計測結果

解析値

Sa(nm)	Sq(nm)	Sz(nm)
8.840	11.222	109.141

測定結果

